

製程/矽智財申請檢核表 (check list)

寄出申請文件前，建議您可依下列「Check List」檢視文件資料是否已備齊：

1. 「OOO 年度製程資料使用申請書」 (已申請過的製程則不須重複繳交此份文件)

- ☐ 教授簽章及填寫身分證字號
- ☐ 蓋系所章
- ☐ 外籍教授需提供有效 ①聘僱證明影本 ②居留證明影本

2. 【使用者名單】 (一份可填多個並跨類別的製程代號)

- ☐ 填上所申請的製程代號
- ☐ 填寫被授權使用者(學生或研究人員)相關資料
- ☐ 附上有當學期註冊章之學生證影本 (或在學證明) 並裝訂於後
- ☐ 研究人員需提供 ① 校方有效聘書影本 ② 與申請人(教授)間雇傭關係之有效證明文件
- ☐ 被授權使用者若為外籍身份需再加附有效居留證影本
- ☐ 【使用者名單】下方需由教授簽章

3. 下載並鍵入使用者名單 (Excel 檔)： (請勿更動檔案內容欄位與設定，以避免系統程式無法讀取)

- ☐ email 至 tsri-process@nlar.org.tw 信箱

4. TSMC NDA (EDA Cloud 製程適用)

- ☐ NDA 附件鍵入資料後由被授權使用者共同親簽 2 份

5. 其他 (請依 EDA Cloud/General/ TSMC FinFET Program 各製程申請之需要繳交)：

- ☐ 矽智財使用申請書(部份製程之 IP 適用)：請教授簽章、填寫教授 ID、蓋系所章
- ☐ TSMC FinFET Program 之 NDA 附件(Exhibit C 與 Exhibit E；申請 ADFP 不需繳交)

(上列文件請寄/送至 300 新竹市科學園區展業一路 26 號 台灣半導體研究中心 製程/矽智財申請)